

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

①

② BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES



PATENTAMT

Int. Cl. 2:

H 01 J 3/02

H 01 J 37/06

1
1
1
DT 23 49 352 B 2

Auslegeschrift 23 49 352

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Aktenzeichen: P 23 49 352.8-33
Anmeldetag: 2. 10. 73
Offenlegungstag: 11. 4. 74
Bekanntmachungstag: 21. 7. 77

⑨

Unionspriorität:

⑩ ⑪ ⑫

3. 10. 72 Niederlande 7213355

⑬

Bezeichnung:

Verfahren zum Betrieb eines Elektronenstrahlerzeugers

⑭

Anmelder:

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Niederlande)

⑮

Vertreter:

David, G.M., Pat.-Ass., 2000 Hamburg

⑯

Erfinder:

Mast, Karel Diederick van der; Barth, James Edmond;
Delft (Niederlande)

⑰

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

DT-PS 10 28 244

US 33 88 280

DT 23 49 352 B 2

7 77 709 529/354

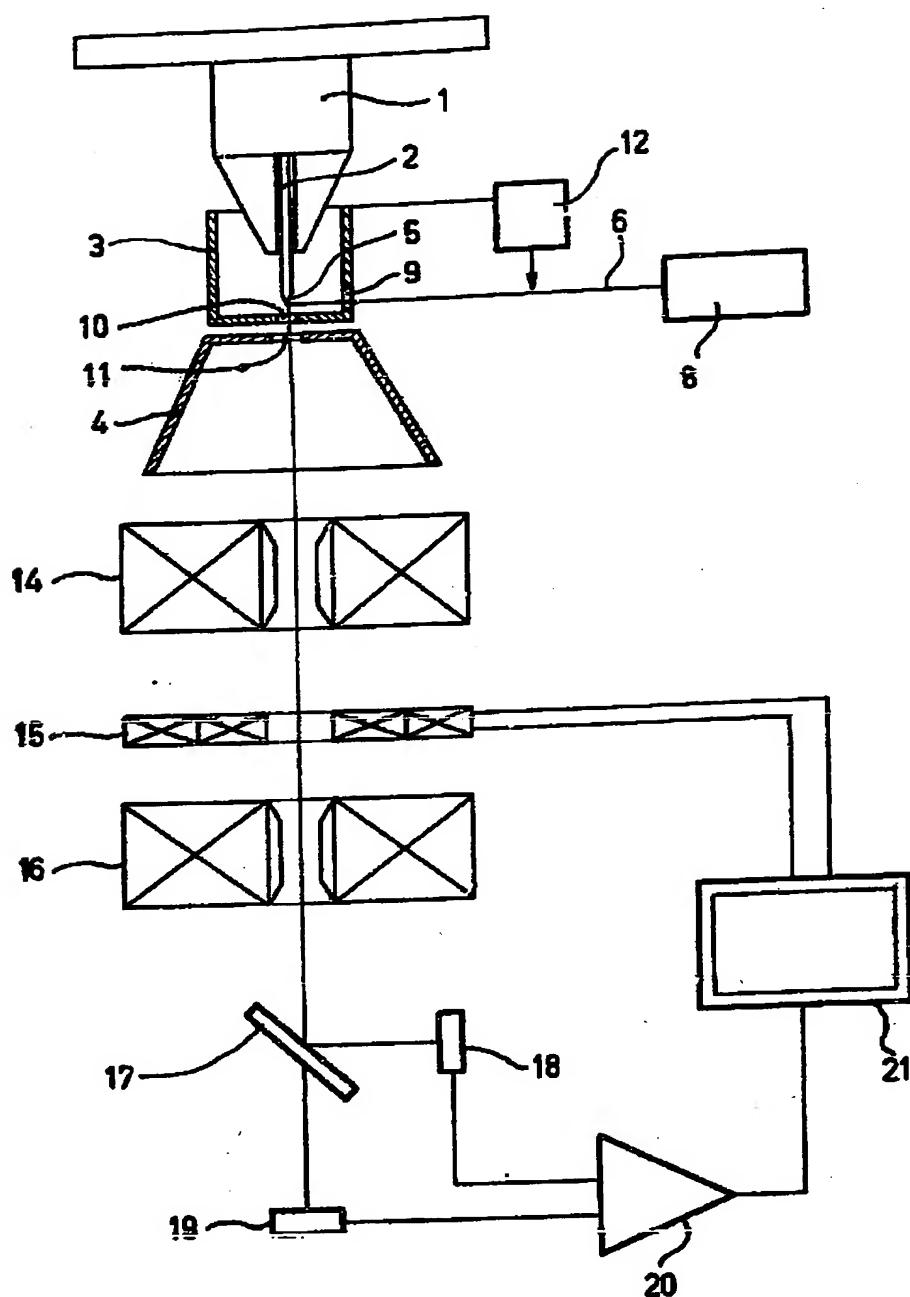


Fig. 1

Patentansprüche:

1. Verfahren zum Betrieb eines Elektronenstrahlerzeugers mit einer Kathodenspitze, die sich am freien Ende eines Kathodendrahts befindet und im Betrieb durch einen Hilfsstrahl erhitzt wird, mit einer Vorschubeinrichtung für den Kathodendraht und mit einer der Kathodenspitze gegenüberliegenden, mit einer Bohrung versehenen Elektrode, an die ein gegenüber der Kathodenspitze positives Potential angelegt wird, dadurch gekennzeichnet, daß ein Kathodendraht von höchstens 50 μm Durchmesser verwendet wird, daß an der Kathodenspitze eine elektrische Feldstärke von 10^5 bis 10^6 kV/m erzeugt wird und daß der Vorschub des Kathodendrahts in Abhängigkeit von der Energiezufuhr des Hilfsstrahls auf die Kathodenspitze so gesteuert wird, daß an der Kathodenspitze ein Krümmungsradius von 0,2 bis 2 μm aufrechterhalten wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Hilfsstrahl der Strahl eines kontinuierlich arbeitenden Lasers verwendet wird, dessen Intensität durch einen vom Strahlstrom des Elektronenstrahlerzeugers hergeleitetes Signal moduliert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß durch das die Strahlenintensität des Hilfsstrahls steuernde Signal eine senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung des Hilfsstrahls bewegbare Abfangblende gesteuert wird.

4. Verfahren zum Betrieb eines Elektronenstrahlerzeugers nach Anspruch 1, 2 oder 3, bei dem der Kathodendraht in der Vorschubeinrichtung durch zwei Klemmen gehalten wird, deren Klemmflächen in Ebenen liegen, die sich nahezu senkrecht in einer mit der optischen Achse des Elektronenstrahlerzeugers zusammenfallenden Geraden schneiden, bei dem die Klemmen der Vorschubeinrichtung alternierend geöffnet und geschlossen werden und bei dem die der Kathodenspitze nächstliegende Klemme der Vorschubeinrichtung eine oszillierende Bewegung in Drahtrichtung ausführt, dadurch gekennzeichnet, daß die Verschiebung des Kathodendrahts durch ein vom Emissionsstrom der Kathodenspitze hergeleitetes Signal gesteuert wird.

5. Elektronenstrahlerzeuger zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorschubeinrichtung elektrisch leitende Drähte enthält, die durch mit elektrischen Stromimpulsen erzeugte thermische Längenänderungen die Klemmen betätigen.

6. Elektronenstrahlerzeuger nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorschubeinrichtung eine Vorrichtung aufweist, die das gleichzeitige Öffnen der Klemmen verhindert und daß diese Vorrichtung beim Einschieben eines neuen Kathodendrahts außer Betrieb gesetzt werden kann.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Elektronenstrahlerzeugers mit einer Kathodenspitze, die sich am freien Ende eines Kathodendrahts befindet und im Betrieb durch einen Hilfsstrahl erhitzt wird, mit einer Vorschubeinrichtung für den Kathoden-

draht und mit einer der Kathodenspitze gegenüberliegenden, mit einer Bohrung versehenen Elektrode, an die ein gegenüber der Kathodenspitze positives Potential angelegt wird.

Ein solches Verfahren ist z. B. aus der DT-PS 10 28 244 bekannt. Die Kathode des Elektronenstrahlerzeugers besteht dabei aus einem Wolframdraht mit einem Durchmesser von 100 bis 200 μm , dessen Ende von einem Ionenbündel geheizt wird. Das Ionenbündel wird durch ein elektrisches Feld auf die Drahtspitze gelenkt. Die maximale thermische Elektronenemission, die eine derartige Kathode liefern kann, wird vom Werkstoff, von der Geometrie und von der Temperatur der Drahtspitze bestimmt. Die Einstellung dieser Kathode auf eine hohe Emissionsstromdichte führt zu einer hohen Temperatur, die eine verhältnismäßig große Verdampfung der Kathodenspitze auslöst. Der Kathodendraht muß deshalb jeweils nach einer gewissen Brenndauer vorgeschnitten werden. Der verdampfte Werkstoff wird jedoch das Innere des Gerätes stark verschmutzen und durch die intermittierende Methode des Drahtvorschubs treten Schwankungen im Emissionsstrom auf.

Es sei noch bemerkt, daß es aus der US-PS 33 88 280 bekannt ist, die Kathode eines Elektronenstrahlerzeugers durch einen Laser zu heizen.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Betrieb eines Elektronenstrahlerzeugers der eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem insbesondere Schwankungen des Emissionsstromes und eine starke Verschmutzung des Gerätes vermieden werden.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gelöst, das dadurch gekennzeichnet ist, daß ein Kathodendraht von höchstens 50 μm Durchmesser verwendet wird, daß an der Kathodenspitze eine elektrische Feldstärke von 10^5 bis 10^6 kV/m erzeugt wird und daß der Vorschub des Kathodendrahts in Abhängigkeit von der Energiezufuhr des Hilfsstrahls auf die Kathodenspitze so gesteuert wird, daß an der Kathodenspitze ein Krümmungsradius von 0,2 bis 2 μm aufrechterhalten wird.

Ein solcher Krümmungsradius ist bedeutend größer als bei Feldemissionsquellen, wodurch der Verlust an wirksamer Helligkeit durch unvermeidlich auftretende Linsenfehler in dem elektronenoptischen Gerät, in dem der erfundungsgemäß betriebene Elektronenstrahlerzeuger eingesetzt wird, stark verringert wird.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird als Hilfsstrahl der Strahl eines kontinuierlich arbeitenden Lasers verwendet, dessen Intensität durch einen vom Strahlstrom des Elektronenstrahlerzeugers hergeleitetes Signal moduliert wird. Das die Strahlintensität des Hilfsstrahls steuernde Signal kann dabei durch eine senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung des Hilfsstrahls bewegbare Abfangblende gesteuert werden.

Bei einem Verfahren zum Betrieb eines Elektronenstrahlerzeugers der beschriebenen Art, bei dem der Kathodendraht in der Vorschubeinrichtung durch zwei Klemmen gehalten wird, deren Klemmflächen in Ebenen liegen, die sich nahezu senkrecht in einer mit der optischen Achse des Elektronenstrahlerzeugers zusammenfallenden Geraden schneiden, bei dem die Klemmen der Vorschubeinrichtung alternierend geöffnet und geschlossen werden und bei dem die der Kathodenspitze nächstliegende Klemme der Vorschubeinrichtung eine oszillierende Bewegung in Drahtrichtung ausführt, wird gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung

die Verschiebung des Kathodendrahtes durch ein vom Emissionsstrom der Kathodenspitze hergeleitetes Signal gesteuert. Die Drahtspitze bleibt dabei gegenüber einer zum Durchlassen eines Strahlstromes durchbohrten Elektrode mit einem in bezug auf die Drahtspitze positiven Potential angeordnet. Durch geeignete Wahl des Drahtdurchmessers und die Art der Heizung der Kathodenspitze bleibt die Verdampfung des Drahtes innerhalb zulässiger Grenzen.

Die Erfindung betrifft weiter einen Elektronenstrahl- erzeuger zur Durchführung des erläuterten Verfahrens, der dadurch gekennzeichnet ist, daß die Vorschubeinrichtung elektrisch leitende Drähte enthält, die durch mit elektrischen Stromimpulsen erzeugte thermische Längenänderungen die Klemmen betätigen. Die Vorschubeinrichtung kann dabei eine Vorrichtung ... weisen, die das gleichzeitige Öffnen der Klemmen verhindert und die beim Einschieben eines neuen Kathodendrahtes außer Betrieb gesetzt werden kann.

Die sehr hohe Stromdichte bei dem erfindungsgemäß Verfahren ist dadurch möglich, daß den Bedingungen für die sogenannte Temperaturfeldemission, die durch den Schottky-Effekt ausgelöst wird, entsprochen ist. Durch diesen Effekt, der bei einer ausreichend hohen Feldstärke an der Oberfläche und einer ausreichend hohen Kathodentemperatur auftritt, brauchen die Elektronen weder das gesamte Austrittspotential zu überwinden, wie es bei der Wärmeemission erforderlich ist, noch die Potentialsperre zu durchbrechen, wie dies bei der Feldemission erforderlich ist. Das zu überwindende Austrittspotential wird durch das angelegte elektrische Feld stark herabgesetzt, so daß bei gleicher Temperatur die Emission pro Oberflächeneinheit wesentlich höher sein kann. Bei einer gerade unter dem Schmelzpunkt des Kathodenwerkstoffes liegenden Temperatur ergibt sich noch die überraschende und vorteilhafte Nebenwirkung, daß die Elektronenemission völlig unabhängig von der Kristallrichtung ist. Da bei einer niedrigeren Temperatur die Emissionsdichte in Drahtrichtung bedeutend niedriger ist als senkrecht zu ihr, wird dadurch ein wesentlich höherer Strahlstrom erreicht. Einige Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt

Fig. 1 ein entsprechend dem Verfahren nach der Erfindung betriebener Elektronenstrahlerzeuger in einem Abtastelektronenmikroskop,

Fig. 2 ein gemäß dem Verfahren nach der Erfindung betriebener Elektronenstrahlerzeuger mit einem Laser als Hilfsstrahlquelle, und

Fig. 3 eine Vorschubeinrichtung für den Kathodendraht in einem Elektronenstrahlerzeuger nach Fig. 1 oder 2.

Das in Fig. 1 skizzenhaft dargestellte Abtastelektronenmikroskop enthält einen in einem Halter 1 montierten Kathodendraht 2, eine erste Anode 3 und eine zweite Anode 4. Vom Kathodendraht 2 wird ein freies Ende oder die Spitze 5 durch ein Strahlenbündel 6 aufgeheizt, das in einer Hilfsstrahlquelle 8 erzeugt wird. Die Hilfsstrahlquelle ist in diesem Ausführungsbeispiel als Laser ausgeführt, von dem ein Strahlenbündel im infraroten, sichtbaren oder ultravioletten Wellenlängenbereich über ein der Wellenlänge der Strahlung angepaßtes, nichtgezeichnetes Fenster und eine Öffnung 9 in der ersten Anode 3 auf die Kathodenspitze 5 auftrifft. Durch die Bohrungen 10 und 11 in der ersten Anode 3 bzw. der zweiten Anode 4 wird aus dem Gesamtemissionsstrom der Kathodenspitze 5 ein im

Abtastelektronenmikroskop zu verwendender Strahlstrom abgetrennt. Über eine weiter nichtgezeichnete Öffnung und ein nichtgezeichnetes Fenster, das vorzugsweise seitlich des Laserstrahls angeordnet ist, kann die Kathodenspitze beobachtet werden. Mit einem Regelmechanismus 12 wird der der Kathodenspitze zuführende Energiestrom gesteuert.

Vom Abtastelektronenmikroskop sind weiter eine Kondensorlinse 14, eine Ablenkeinheit 15, ein Objektiv 16, ein Objekt oder Präparat 17 und die Detektoren 18 und 19 dargestellt. Ein von einem der Detektoren empfangenes Signal wird über einen Signalverstärker 20 an einem mit der Ablenkeinheit 15 gekoppelten Fernsehmonitor 21 wiedergegeben.

Im Betrieb führt die erste Anode, zum Erfüllen der Bedingungen für Temperaturfeldemission, ein Potential von z. B. einigen tausend Volt in bezug auf die Kathodenspitze. Die zweite Anode liegt dabei auf einem in bezug auf die Kathodenspitze positiven Potential von mehreren tausend Volt. Selbstverständlich sind diese Potentialwerte auch von der Geometrie der beiden Anoden, von den Abmessungen der Bohrungen in den Anoden, vom gegenseitigen Abstand der Anoden und von deren Abstand zur Kathodenspitze abhängig.

Wie bereits oben bemerkt, muß für die gewünschte Emissionsform eine Feldstärke von ungefähr 10^5 bis 10^6 kV/m an der Oberfläche der Kathodenspitze erzeugt werden.

Fig. 2 zeigt skizzenhaft eine Anordnung zum Einstellen des Kathodendrahtes auf die gewünschten Emissionseigenschaften. Ein aus einem kontinuierlich strahlenden Laser 31 stammender Strahl mit einer Energie von z. B. etwa 5 Watt wird mit einer Linse oder mit einem Linsensystem 32 an der Stelle der Kathodenspitze 5 zu einem Brennfleck mit äußerst geringer, nur durch Beugungerscheinungen der kohärenten Laserstrahlung bestimmten Querabmessung fokussiert.

Der Kathodendraht 2 wird von einer Vorschubeinrichtung festgehalten, die in der Halter 1 aufgenommen ist und die in Fig. 3 dargestellt ist. Die Vorschubeinrichtung dient dazu, die Drahtspitze 5 der Drahtkathode 2 während des Betriebs des Elektronenstrahlerzeugers genau an einer festen Stelle zu halten und durch Zufuhr von Kathodenwerkstoff dessen Verdampfung auszugleichen. Die erste Anode 3 ist dazu mit einer Gleichspannungsversorgungseinheit 33 verbunden. Durch den Emissionsstrom entsteht an einem Widerstand 34 ein Spannungsunterschied, der mit Hilfe eines Gleichspannungsverstärkers 35 mit einer aus einer Versorgungseinheit 36 herrührenden Spannung verglichen wird. Ein auf diese Weise gewonnenes Differenzsignal wird in einem Integrator 37 integriert und treibt über einen Stromverstärker 38 einen Transportmechanismus der Vorschubeinrichtung an. Mit diesem Transportmechanismus kann der Kathodendraht 2 langsam, z. B. um einige μm pro Minute, in Drahtrichtung vorgeschoben werden. Die Kathodenspitze 5 ragt dabei mehr oder weniger in das Laserbündel, wodurch seine Energiezufuhr geregelt wird. Durch diesen Ansteuemechanismus werden eventuell auftretende langsame Schwankungen in der Laserintensität oder in der Geometrie der Kathodenspitze, z. B. durch Werkstoffverdampfung, ausgeglichen.

Zum Nachregeln solcher Schwankungen dient ein Steuersignal, das aus einem durch eine Gleichspannungsversorgungseinheit 39 über einen Widerstand 40 zu liefernden Anodenstrom gewonnen wird. Über einen

Kondensator 41 steuert dieses Signal einen elektrody-
namischen Umformer 12, der die Stellung einer im
Laserstrahl liegenden Abfangblende 43 einstellt. Mit
dieser Abfangblende kann ein Teil des Laserstrahls
abgefangen werden, wodurch die der Kathodenplatze
zugeführte Energie abnimmt. Der Laserstrahl kann
dabei einseitig, an mehreren Seiten oder ringherum
eingeschnürt werden.

In der Fig. 3 ist ein Ausführungsbeispiel einer
Vorschubeinrichtung wiedergegeben: Ein vorgespannter
Wolfrändraht 2 wird von den Klemmbäcken 50 und
51 festgehalten. Ein federndes Befestigungs-Element 52
für die Klemmbäcke 51 liefert dazu eine Klemmkraft.
Die Klemmbäcke 50 und 51, das federnde Befestigungs-
Element 52 und eine Platte 53 bilden zusammen
einen Greifer, der sich durch ein paralleles Federnsy-
stem mit den Federn 54, 55, 56 und 57 nur in einer
Richtung, und zwar entlang der Achse des Elektronen-
strahlerzeugungssystems bewegen kann. Ein Draht 58
zieht die Platte 53 zu einer Montageplatte 59 hin. Durch
thermische Längenänderung des Drahtes 58 verlagert
sich die Platte 53 und der Kathodendraht 2 wird
vorgeschoben. Während dieser Bewegung ist ein
zweites Klemmbackenpaar 59, 60 geöffnet. Sobald ein
Hubende der Platte 53 erreicht worden ist, so befreit
sich die Klemmbäcke 59 und 60 um den Kathodendraht,
öffnen sich die Klemmbäcke 50 und 51 und die
Platte kehrt in ihre Anfangsstellung zurück, so daß der
beschriebene Vorgang sich wiederholen kann. Eine
nicht dargestellte Kupplung zwischen den Klemmbäck-
ken kann verhindern, daß die beiden Klemmbackenpaar-
re gleichzeitig geöffnet sind. Zum Einführen eines neuen
Kathodendrahtes kann diese Kupplung außer Betrieb
gesetzt werden.

Während des Betriebes wird der Draht 58 durch einen
Heizstrom aufgeheizt, der vom Stromverstärker 38
geliefert wird (siehe weiter Fig. 2). Da die Klemmflä-
chen der Klemmbäcke 50, 51 und 59, 60 senkrecht
zueinander angeordnet sind, wird nach wiederholtem
Übergreifen ein neu eingesetzter Kathodendraht 2
entlang der Schnittlinie der beiden Klemmflächen
fixiert. Hierdurch reproduziert dieser Mechanismus

selbsttätig äußerst genau den Ort der Drahtachse: Das
Öffnen und Schließen der Klemmbäcke 50, 51 und 59,
60 zum Vorschlieben des Kathodendrahtes wird durch
Strömsteuerung, also durch thermische Längenände-
rung der Drähte 62 und 63 bewirkt.

Durch die Verwendung eines dünnen Drahtes und das
äußerst genaue ununterbrochene Nachstellen der
Kathodenspitze trifft insbesondere in Drahtrichtung,
eine viel höhere Emissionstromdichte auf als in den
bekannten thermischen Elektronenstrahlerzeugern dieser
Art; gleichzeitig ist der Nachteil des, wegen ihrer
geringen Abmessungen, zu geringen wirksamen Stroms
der Feldemissionsquelle beseitigt. Es zeigt sich, daß
durch Verdampfung und Oberflächenwanderung am
sich ständig weiterschiebenden Kathodendraht eine
Drahtspitze mit einem Krümmungsradius von ungefähr
1 μm aufrechterhalten wird. Im kräftigen Feld an der
Kathodenspitze kann bedingt durch die hohe Temperatur
der Kathodenspitze, die dadurch die gewünschte
Abmessung bekommt, der bereits in der Einführung
erwähnte Schottky-Effekt oder die sogenannte Temperatur-Feldemission auftreten. Auf diese Weise liefert ein
Wolfrändraht mit einem Durchmesser von 10 μm als
Kathodendraht bei einer Temperatur von ungefähr
3500°K aus einer Spitz mit einem Krümmungsradius von
ungefähr 1 μm, die gegenüber einer in bezug auf die
Kathodenspitze auf einem Potential von +2000 V
liegenden Anode angeordnet ist, eine Emissionstrom-
dichte in der Größenordnung von 10⁴ A/cm².

In einer Quelle mit einer derartigen hohen Stromdich-
te bei der gegebenen Querabmessung kann auf einfache
Weise ein Elektronenstrahl erzeugt werden, der sich
insbesondere als Strahlstrom in einem Abtastelektro-
nennmikroskop eignet, in dem Fernsehtechniken zum
Darstellen der Bildinformation angewandt werden.

Neben dem oben beschriebenen Abtastelektronenmikro-
skop können z. B. auch ein Transmissionselektronen-
mikroskop, ein Elektronenstrahlbearbeitungsgerät und
ein Mikroanalysator mit Vorteil mit einem erfundungs-
gemäß betriebenen Elektronenstrahlerzeuger ausgeri-
stet werden.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen

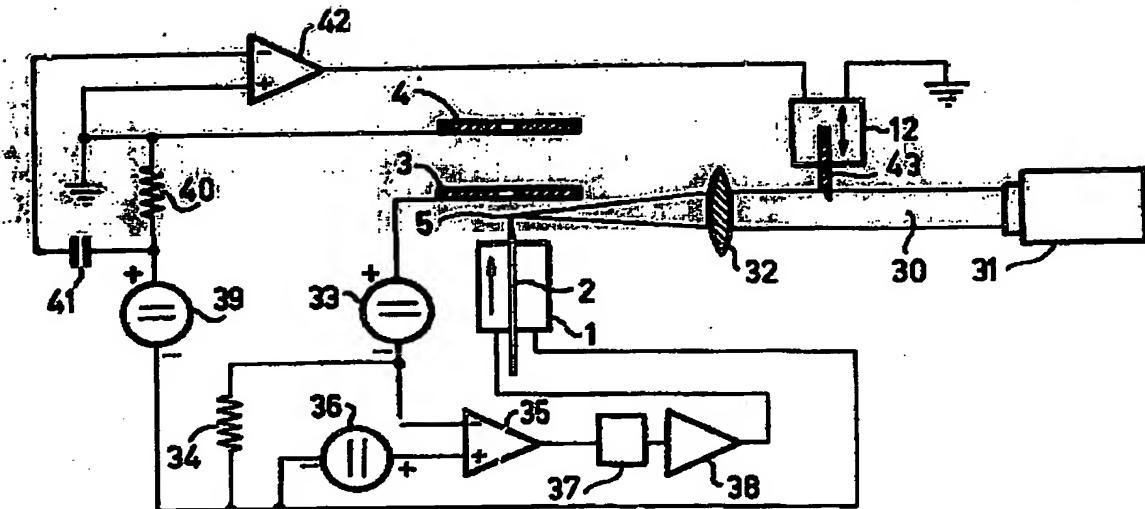


Fig. 2

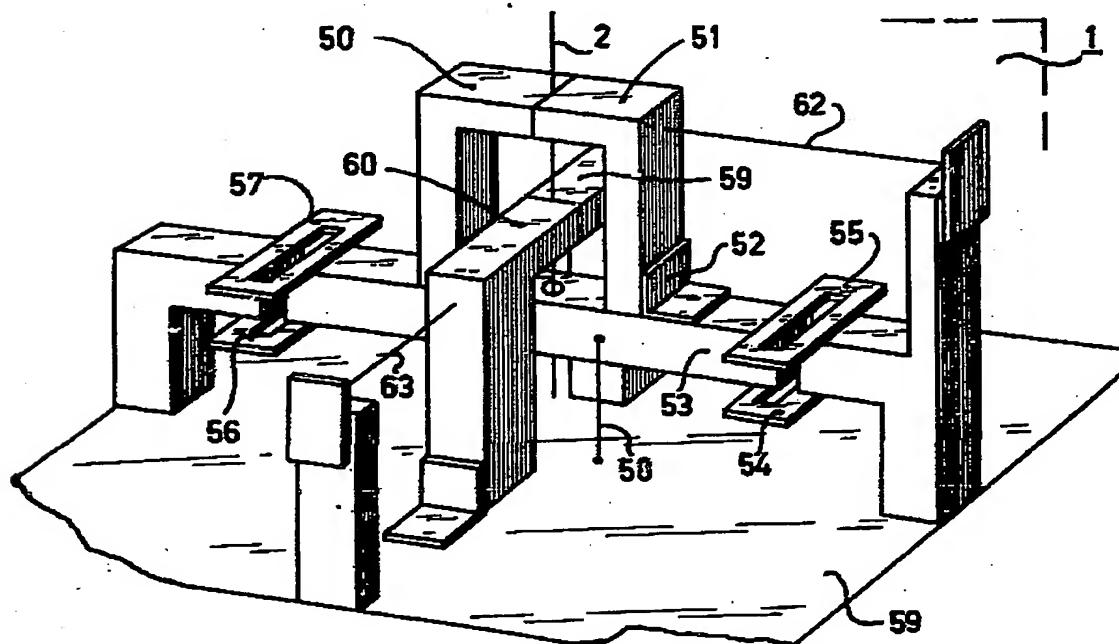


Fig. 3